RESULTS OF HIGH-POWER KLYSTORON DIP TEST IN THE KEK LINAC

K.Nakao, H. Katagiri, T.Matsumoto, S.Michizono, T.Takenaka, Y.Yano, H.Yosida, S. Fukuda High Energy Accelerator Research Organization 1-1 Oho, Tukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

Dip test, which is the measurement of a klystron heater activity, is recently adopted as the standard measurement to maintain the klystron operation in the KEK electron-positron linac. Last year, we began to use a dip test as the quick way to measure the emission characteristics from the klystron cathode. After the successful results, we made the dedicated measuring systems and measured the dips of the cathode emission of 60 operating klystrons in the KEK electron-positron linac. These data are important to estimate the klystron cathode life and used to select the candidate klystrons of replacement in the summer shut down period.

KEK電子陽電子加速器における大電力クライストロンディップ試験の結果

概要

高エネルギー加速器研究機構(KEK)の電子.陽電子 ライナックではSバンド大電力のクライストロンが 60台稼動している。これらのクライストロンを安定 に動作させる為にクライストロンに通電するヒータ 電力を監視し、通常はカソードの動作領域が空間電 荷制限領域であるように保っている。しかし稼動時 間とともにヒータの活性度は低下していき最終的に はエミ減となり交換する事となる。このためヒータ 電力(電圧)の適正値を把握しておく必要がある。そ の方法のひとつとして短時間で適正エミッションを 評価できるディップ試験と呼ばれる方法がある。 我々は昨年度この試験をエミッション減少(エミ減) の数本のクスライストロンに実施し、エミッション の活性度の測定に有用な結果が得られた[1]。KEKライ ナックではメンテナンスに対する情報として全クラ イストロンにわたりディップ試験を行っており、本 論文はこの結果について報告する。

1.はじめに

KEKにおける電子.陽電子ライナックでは60台の大電力クライストロン(周波数2856MHz,運転最大パルス出力電力46MW,平均パルス出力電力41MW、RFパルス幅4μs、繰り返し50pps、マイクロパービアンス2.1)が稼動している。年間7,000時間の運転を行い、クライストロンの平均寿命は30,000時間以上である。年間の平均交換台数は5~8本程度である[2]。その交換要因としては、窓の破損、管内放電等いろいるよこの平均を測定する方法として、通常はヒータの活性度を測定する方法として、通常はヒータ電力(電圧、ヒータ温度)に対するエミッションに関いては、一定値から減少し始める変化のポイント、又は肩の位置を調べる。この特性はエミッ

ションの肩特性またはMi ram Plotと呼ばれる[3]。これは各ヒータ電力の動作点ごとに熱的平衡に達してからエミッションを測定する。1台のクライストロン対し肩特性測定を終了するのに半日程度の時間必要である。これに対し効率的かつ迅速にエミッションの活性度を測る試みとしてディップ試験と呼を短時間オフしてエミッション電流の変化を測定である。Mi ram Plotとの関係を図1に示す。これから解るように動作点が正常であればディップの深さは浅く、動作点がぎり又は既に肩の位置であればディップは深くなる

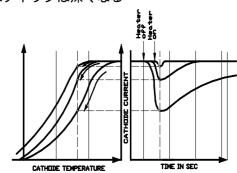


図1:Miram Plotとディップ試験

2.カソードのディップ試験の現状

昨年の報告[1]の通りディップ試験の有用性が確認されたため、現在ディップ試験は専用の測定装置を用いて行なっている。これはデジタルオシロスコープ、デジタルボルテージメータ及びノート型パソコンで構成されている。オシロの制御およびデータの取得はLab Viewを用いてGPIB経由で自動的に行われ迅速な測定が可能となった[4]。ヒータのオフ・オンに関してはクライストロンモジュレータのヒータ回路

にあるNFBを手動でオフ-オンして行っている。我々 の大電力クライストロンでは、このオフ時間は60秒 である。通常はクライストロンの保護のためヒータ がオフになれば高圧オフになるようなシークエンス となっているので、この測定の間のみインターロッ クを殺さなければならないので注意が必要である。 図2にこの測定装置の概要を示す。全体としてコン パクトでキャスター付の小机に載せて移動できる。 ディップ試験は装置の接続、インターロックの解除、 測定、インターロックの復旧、装置の取り外しの手 順で行われ、測定開始から終了まで約15分程掛かる。 これはヒータを再度オンしてからカソードが熱的に 安定するまでに掛かる時間も含んでおり、単にディ ップを測定するだけなら5分で終える事ができる。 この15分間、測定されるクライストロンはビーム運 転には用いる事が出来ない。従来KEKのライナックで は夏季と冬季のシャットダウン前に限ってMiram Plotを取る方法でエミッション電流の測定を行って きた。前述の通りこの測定は通常5~6点ヒータ電力 を変えて測定を行う必要があるのと、熱的平衡に達 するまで30分以上かかるのとで、1本のクライスト ロンのMiram Plotを取るのに3~4時間必要であった。 2004年4月からKEKBリングへの連続入射が始まり、時 間的な制約からこのような長時間を要する測定を実 施すことは困難になった[5]。

前述したようにディップ試験では1台のクライストロンの試験に15分しか必要としない。我々は測定装置2台でライナック全クライストロンのディップ試験を行うことにした。60台のクライストロンに対する測定は短期メンテやビーム運転停止中などの短い空き時間を利用して行った。ヒータ電圧は110V(運転値)、印加電圧も安全のため270kV(運転値300~320kV)に設定した。

測定はのべ3~4日で終了しビーム運転に支障をきたすことも無かった。我々は2004年5月までに4回の 測定を行い多くのデータを得ることができた。

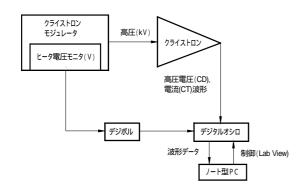


図2:ディップ試験概略

3.ディップ試験結果

図3にクライストロンギャラリィにおける全クライストロンディップ試験の結果を示す。縦軸はディ

ップの深さを%で表してある。ヒータオフの時のエミッションが通常のヒータオン時に比べどのくらい変化しているかを表している。1回の測定結果だけではその時のエミッションの状態しか確認できない。数回の測定結果を時間経過とともに比較する事によってヒータの活性度の低下の進み具合がわかる。つまりディップの深さの絶対値ではなく、ディップの深さの相対的な増加によってエミ減の判断を下す。しかしながら、1回の試験結果においてもある一定のパーセンテージを超えているものはエミ減の傾向にあると考えられ、監視的なディップ試験の対象となる。

通常稼動時間と共にヒータの活性度も低下してい き、ディップの深さ(変化率)も深くなっていくが、 逆に前の時の測定よりも浅くなっている箇所がある。 これはノイズや測定装置の違いによるものとおもわ れる。また図3においてA-3では極端にディップが 浅くなっているが、これはクライストロンを交換し たためである。ほとんどのクライストロンのディッ プの深さは5%以内におさまっている。またディッ プの深さの増加が急激に上がったところも無い。た だディップの深さは浅くても、測定ごとに確実に深 さの割合が増加しているものがある。エミ減はある 時期から急激に進むのでこのようなクライストロン は交換の対象となる。図4にそのようなクライスト ロンのディップの変化を示す。時間とともにディッ プが深くなっていきカソードが劣化していくのがわ かる。図3の 印を付けたものが今年度交換を実施 する予定のものである。全体的にクライストロンの ディップの深さは、少しづづではあるが増加してお り、経年的にヒータの活性度が低下していると言え る。これらのクライストロンはまだ顕著なエミ減の 傾向を示していないが、引き続き定期的にディップ 試験を行い監視するとともに、蓄積した測定結果を データベース化する予定である。

4.まとめ

ディップ試験を用いれば、全クライストロンのヒータの活性度の測定を短期間に、ビーム運転に影響を与えずに、出来ることが分かった。試験は4回とも運転の空き時間を利用して行ったもので、かなり時間的に制約を受けたが、順調に試験を終了した。多数のクライストロンのカソードの活性度の測定に行う為の手段としてディップ試験は非常にあずある。測定毎のディップの変化率を観察するそれによりクライストロンがエミ減で完全に使用不能になる前に交換する事が容易になる。また自動化した事により測定も簡単に速く行えるようになった。

5.今後の課題

16 03/09測定 14 KLY交換 KLY交換予 12 03/12測定 10 04/03測定 × 8 04/05測定 6 4 2 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 11 12 13 14 15 16 17 18 Klystron gallery unit

クライストロンギャラリィにおけるデッィプの深さの変化(A,B,Cセクタ)

クライストロンギャラリィにおけるデッィブの深さの変化(2,3,4,5,6セクタ)

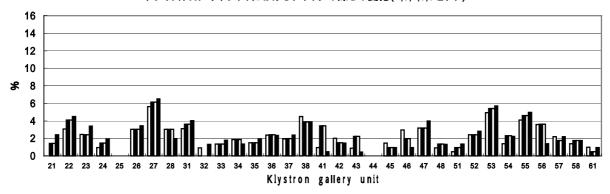


図3:クライストロンギャラリィにおけるディップ試験の結果

この4回の試験中、データが取れなかったクライ ストロンが数本あった。これは時間的な問題ではな くなく電源のノイズ等によるLab Viewの誤動作の問 題であった。そのためまだプログラムの改良の余地 がある。またノイズに対する対策を講じ、より正確 にデータを収集する事が望まれる。

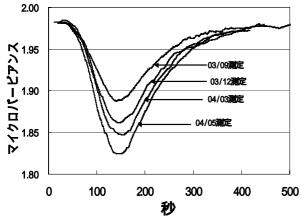


図4:1-6のクライストロンのディップの変化

参考文献

- [1] 中尾、他、" 大電力クライストロンのヒータ 特性測定の為のディップ試験", Proc of the 28th Linear Acclerator Meeting in Japan, 2003, pp.360
- [2]Y. Imai,et al.," Maintenance Activity of RF Source in KEK Electron-Positron Linac", presented in this meeting.
- [3] A.S.Gilmour jr., Ch.5 of "Principles of Traveling Wave Tube", Arthch House INC.,1994.
- [4] H.Katagiri, et al., "Data Taking System of the RF Measurement at KEK e⁺/e⁻ Injector Linac", presented in this meeting.
- [5] Y.Ogawa, "Present Status of the KEK Electron /positron Injector Linac", presented in this meeting.